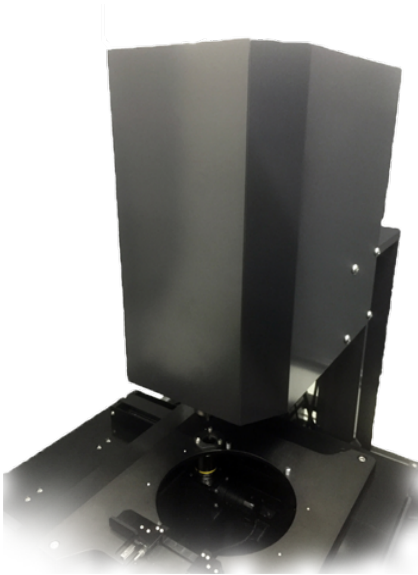


GEMINI 両面位置ずれ検査装置

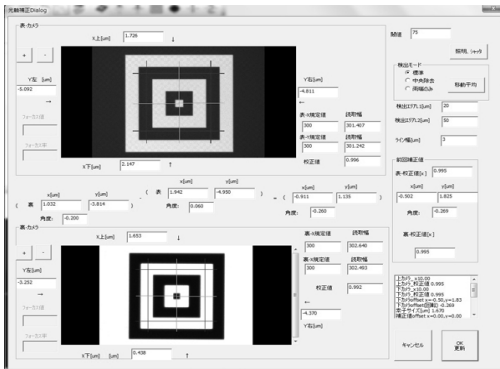
可視・IR対応



従来の測定精度を超えたフルオート測定機
分解能 0.08 μ m/ピクセル 20 \times 対物使用時
再現性 $\sigma=0.5\mu$ m以下
同一箇所の繰返し再現性 $\sigma=0.05\mu$ m以下

測定範囲 6~8インチ ※その他サイズも対応します
画像AF搭載 上下光学系共
自動光軸調整機能付き

表裏露光ウエハのアライメントずれ、パターンずれ
微細加工穴ずれ等
IRによるシリコン透過パターン測定
MEMS デバイス 貼り合わせずれ

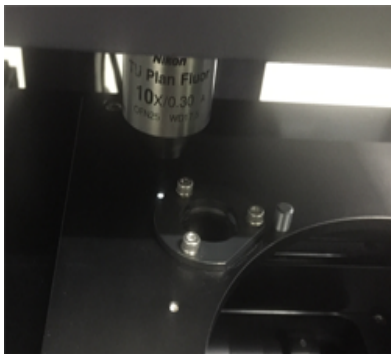


上下の光学系の軸ずれ角度ずれを自動補正

測定時にサンプルホルダーに搭載されたゲージを基準として測定前に補正值を検出
装置の時間経過や温度等のドリフトによる測定値誤差を解消します。

測定項目 表裏ずれ パターン中心-中心、
エッジ検出 簡易測長

機能 XY自動ステージ、Z(上下)自動駆動
自動アライメント検出
測定項目、測定位置レシピ作成機能
画像AF 照明コントロール



クノータクノクラフト株式会社

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 2-10-18

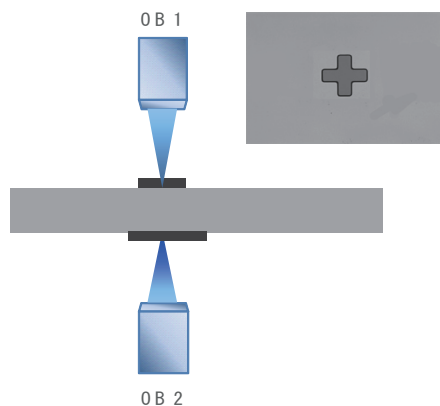
TEL04-2937-6308 FAX04-2937-6309 e-mail kunoh@kunoh.com

<http://www.kunoh.com>

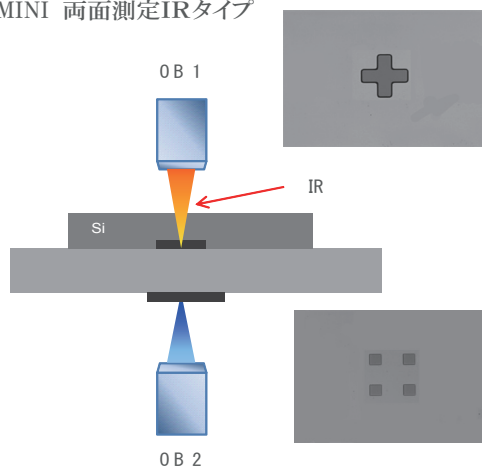
仕様

本体部	1) 装置専用架台 (測定サンプルのサイズにより変更となります。) 2) Z軸 Z1、Z2 ±10mm駆動 画像AFにてフォーカス 3) XY自動ステージ 6インチ、8インチウエハサイズ対応 (それ以外のサイズに対しても対応可能)
光学系	1) 測定用光学系 対物レンズ1本取替式 2) 対物レンズ 5×、10×、20×、50×、100× から選択 (IR仕様の場合は対物レンズはIR専用対物になります) 3) LED照明 可視観察白色8W IR観察100W IR照明
カメラ	1) CMOSカメラ 測定用2式 1/2.3インチ 1.67μm/pixel 測定分解能 10×対物レンズ時 約0.04μm 撮像範囲 約640μm×460μm
測定内容	1) 表裏の位置ずれ測定 2) パターン幅等の寸法計測 3) 画面内での簡易測長 4) パターンマッチングによる画像判定
測定再現性	$\sigma = 0.5\mu\text{m}$ 以下
同一箇所の繰返し再現性	$\sigma = 0.05\mu\text{m}$ 以下 (再現性に関しては測定サンプルにより変わります。上記再現性は装置基準サンプルの場合です)
測定用途	ウエハ/パターンの線幅測定、貼り合せウエハのアライメントずれ、パターンずれ IRによるシリコン透過パターン測定 MEMSデバイス 微小穴や加工品の位置ずれ測定

GEMINI 両面測定タイプ
KP-VS



GEMINI 両面測定IRタイプ



クノーテクノクラフト株式会社

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 2-10-18

TEL04-2937-6308 FAX04-2937-6309 e-mail kunoh@kunoh.com

<http://www.kunoh.com>

KUNOH
Technocraft